Journal of Vibration, Measurement & Diagnosis

doi:10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2019.01.019

水下探测微电容超声波换能器线阵设计与封装

张 睿^{1,3}, 潘理虎¹, 陈立潮¹, 张永梅², 薛晨阳³, 张文栋³, 何常德³

(2.北方工业大学计算机学院 北京,100144) (3.中北大学仪器科学与动态测试教育部重点实验室 太原,030051)

摘要 提出一种应用于水下探测的低频微电容超声波换能器阵列。在分析微电容超声波换能器阵列复合结构和工作原理的基础上,建立了换能器阵元和一维线阵的指向性表达式,并通过分析结构参数对指向性的影响,确定了阵列 几何参数。针对微电容超声波换能器水下应用需求,研究了阵列水下封装方法,通过封装结构设计和封装材料的选 取,完成了换能器阵列水密封装。同时,制定了换能器阵列性能测试方案,并搭建了相应的测试、探测系统,经测试换 能器线阵-3 dB 主瓣宽度为5°,最大旁瓣级为-13.5 dB,可实现水下1 m 范围内的目标清晰探测。实验表明,提出的 微电容超声波换能器阵列设计和封装方法合理,为改善微电容超声波换能器阵列水下探测性能提供了设计依据。

关键词 微电容超声波换能器;阵列设计;阵列封装;水下探测 中图分类号 TB565;TB553

引 言

超声波具有较好的定向性能和穿透性,易于将 声能集中传播,探测范围广,这些优势为快速、准确 获取水下地理信息和资源信息提供了技术保障[1]。 通常将发射和接收超声波的探头称为超声换能器, 它是水下超声探测系统最重要的部件,制约着水下 探测技术的发展。基于微机电系统(micro-electromechanical system, 简称 MEMS) 制作的超声波换 能器 (micromachined ultrasonic transducer, 简称 MUT)是现阶段超声波换能器研究的新热点以及将 来的发展趋势。新型 MUT 利用高精度(微米量级) 微电子和微机械加工技术严格降低了制作阵列的误 差,在优化换能器及其阵列尺寸的同时提高了探测 的分辨率^[2]。基于 MEMS 技术的微电容超声波换 能器(capacitive micromachined ultrasonic transducer,简称 CMUT)被近似认为是一种下电极固 定,上电极振动的微型平行板电容器,工作模式下通 过驱动上电极的振动使平行电容间电容量发生改 变,进而最终达到电能与声能互相转换的目的。

国内外对 CMUT 的研究多是针对 3MHz 以上

医学探测应用,水下探测的研究刚刚起步,现有相关 水下研究^[3-5]并不多见,且报道的 CMUT 频率与医 学探测频率相近(≥2MHz),限制了水下探测距离 (≪300mm)。相比目前国内外水下探测换能器主 要采用的分立压电陶瓷探测阵列、集成压电陶瓷探 测阵列而言,基于光刻工艺的 CMUT 拥有较低的 声特性阻抗,能够在液体环境下实现良好的阻抗匹 配,无需制备表面匹配层,频带较宽,灵敏度较高,且 加工工艺复杂度较低,易于集成阵列^[6-8]。这些优势 使得 CMUT 阵列满足成为水下高分辨率探测声呐 的条件,在水下探测领域具有较好的发展前景。

笔者以实现小型化 CMUT 阵列水下高分辨目 标探测为主要目标,开展了水下探测 CMUT 阵列 几何优化设计、CMUT 水下封装和性能测试技术三 方面的研究,为我国自主研发水下勘探超声设备的 改进提供理论支撑。

1 工作原理

如图 1 所示, CMUT 阵列属于多层复合结构, 阵列由多组阵元规则排列构成,单个阵元又由较多 基础元素敏感单元并行规则排列组成。敏感单元结

^{*} 国家杰出青年科学基金资助项目(61525107);国家自然科学基金资助项目(61371143);"十二五"山西科技重大专项基金资助项目(20121101001);山西省中科院科技合作项目(20141101001);山西省科技攻关项目(20141039);太原科技大学校博士科研启动项目(20162036);山西省应用基础研究资助项目(201801D221179) 收稿日期:2017-05-10;修回日期:2017-12-06

构如图 2 所示,由上而下依次为金属铝上电极、SOI 片的顶层硅制作的振动薄膜、氧化硅隔离层、氧化硅 刻蚀得到的密闭真空腔体、氧化硅绝缘层、硅衬底及 金属铝下电极构成。CMUT 的工作模式离不开直 流偏置电压,工作时需将直流偏置电压施加在上下 电极,产生的静电力将薄膜垂直拉向下电极方向,但 由于薄膜自身存在反向的回复力,薄膜很快停止运 动,达到平衡状态。若此刻再次施加所需频率的交 流激励电压,会使振动薄膜发生挠曲,辐射相应频率 的超声波。若在平衡状态下,外界变化的声压作用 在薄膜上,会使薄膜产生挠曲,进而改变空腔内电容 量,产生微弱的电流信号,后经跨阻放大等处理,电 路实现电压信号接收。综合大气压和水压下最大位 移、塌陷电压、机电转化系数要求以及 Si-SOI 键合



图 1 CMUT 阵列结构示意图 Fig. 1 Structure sketch map of CMUT array











表1 敏感单元主要结构参数

| | Tab. 1 | Main struct | ural parameters | of sensitive | unit | μm |
|--|--------|-------------|-----------------|--------------|------|----|
|--|--------|-------------|-----------------|--------------|------|----|

| 结构 | 上电极 | 上电极 | 隔离层 | 薄膜 | 薄膜 | 空腔 | 绝缘层 |
|----|-----|-----|------|----|----|-----|------|
| 参数 | 半径 | 厚度 | 厚度 | 半径 | 厚度 | 高度 | 厚度 |
| 数值 | 45 | 0.2 | 0.15 | 90 | 3 | 0.8 | 0.15 |

工艺条件,利用课题组 Ansys 有限元分析方法的研 究^[9-10]确定了表 1 所示的敏感单元结构参数。

2 CMUT 一维线性复合阵列指向性

指向性是单个 CMUT 阵元或阵列发射/接收 响应的幅度随主波束角扫描变化的特性^[11],是阵列 设计的重要指标之一。

2.1 CMUT 阵元指向性

分别假设 CMUT 阵元为一圆形平板(半径为 r,直径为 d)和一矩形平板(宽为 a,长为 b), $J_1(x)$ 表示第1类一阶贝塞尔函数, θ 为偏轴角,归 一化指向性表达式^[12]分别为

$$\boldsymbol{D}_{\text{e_circular}}(\theta) = \left| \frac{2J_1(kr\sin(\theta))}{kr\sin(\theta)} \right| = \left| \frac{2J_1(\frac{\pi d\sin(\theta)}{\lambda})}{\frac{\pi d\sin(\theta)}{\lambda}} \right|$$

(1)

$$\mathbf{D}_{e_rectan\,gular}(\theta) = \left| \frac{\sin(ka\sin(\theta)/2)}{ka\sin(\theta)/2} \right| = \left| \frac{\sin(\frac{\pi a\sin(\theta)}{\lambda})}{\frac{\pi a\sin(\theta)}{\lambda}} \right|$$

图 3 为不同尺寸下,面积相当的两种阵元形状 声辐射指向性分布。可以看到,不论阵列单元尺寸 如何变化,面积相当的单个阵列矩形阵元指向性优 于圆形阵元结构。

假设CMUT阵元是由笔者提出的n个均匀排



图 3 CMUT 阵元指向性 Fig. 3 Directivity map of CMUT element

列单元组成的二维矩形平面,由于 $kd_{cell} = 2\pi d_{cell}/\lambda < 1$,敏感单元可以视作点声源^[12]来计算 CMUT 阵元的指向性,如图 4 所示, d_x , d_y 分别为沿 x 轴和 y 轴方向的敏感单元中心间距。根据 Bridge 乘积定 理^[13],得到 CMUT 单阵元在 xOz 平面归一化指向 性函数为

$$\mathbf{D}(\alpha,\theta,\alpha_s,\theta_s) = \mathbf{D}_1(\alpha,\theta,\alpha_s,\theta_s) \times \mathbf{D}_2(\alpha,\theta,\alpha_s,\theta_s) \quad (3)$$
$$\mathbf{D}(\alpha,\theta,\alpha_s,\theta_s) =$$

$$\left| \frac{\sin\left[\frac{kMd_{x}}{2}(\cos_{\alpha}\sin\theta - \cos_{\alpha_{s}}\sin\theta_{s})\right]}{M\sin\left[\frac{kd_{x}}{2}(\cos_{\alpha}\sin\theta - \cos_{\alpha_{s}}\sin\theta_{s})\right]} \right| \times \left| \frac{\sin\left[\frac{kMd_{y}}{2}(\sin_{\alpha}\sin\theta - \sin_{\alpha_{s}}\sin\theta_{s})\right]}{N\sin\left[\frac{kd_{y}}{2}(\sin_{\alpha}\sin\theta - \sin_{\alpha_{s}}\sin\theta_{s})\right]} \right|$$
(4)



图 4 CMUT 单阵元指向性模型 Fig. 4 Directivity model of a single CMUT element

2.2 CMUT 线阵指向性

CMUT 一维线性复合阵指向性模型如图 5 所示, M' 个等大小矩形阵元等间距(间距为 d)沿 x 轴依次排列。由于 $ka = 2\pi a/\lambda > 1$, a 为阵元宽度。 无法 将 阵 列 单 元 近 似 看 作 成 点 声 源^[12], 由 于 CMUT 阵元自身具有指向性,且存在一定的阵元间 距,因此,整个 CMUT 阵列的指向性既与单个 CMUT 阵元有关,又与阵元数的多少及组成的阵形有关,是 CMUT 阵元指向性与阵形指向性的复合系统。同理 依据 Bridge 乘积定理^[13],此时该复合阵的归一化指 向性函数可表示为图 5 (a)所示的基于点声源的均匀 点线阵指向性 $D_{s1}(\alpha, \theta, \alpha_s, \theta_s)$ 和图 5 (b)所示的矩形 点面阵阵元指向性 $D(\alpha, \theta, \alpha_s, \theta_s)$ 的乘积,即

$$\begin{aligned} \boldsymbol{D}_{1\text{Da}_\text{rectan gular}}(\alpha, \theta, \alpha_s, \theta_s) &= \boldsymbol{D}_{s1}(\alpha, \theta, \alpha_s, \theta_s) \times \\ \boldsymbol{D}(\alpha, \theta, \alpha_s, \theta_s) & (5) \\ \boldsymbol{D}_{s1}(\alpha, \theta, \alpha_s, \theta_s) &= \\ & \left| \frac{\sin\left[\frac{kM'd}{2}(\cos\alpha\sin\theta - \cos\alpha_s\sin\theta_s)\right]}{M'\sin\left[\frac{kd}{2}(\cos\alpha\sin\theta - \cos\alpha_s\sin\theta_s)\right]} \right| & (6) \end{aligned}$$

若取 *xOz* 定向面,该 CMUT 一维线性复合阵 列归一化指向性参量表达式为

$$D_{1\text{Da}_{rectan gular}}(0,\theta,0,\theta_{s}) = \left| \frac{\sin\left[\frac{kM'd}{2}(\sin\theta - \sin\theta_{s})\right]}{M'\sin\left[\frac{kd}{2}(\sin\theta - \sin\theta_{s})\right]} \right| \times \left| \frac{\sin\left[\frac{kMd}{2}(\sin\theta - \sin\theta_{s})\right]}{M\sin\left[\frac{kd}{2}(\sin\theta - \sin\theta_{s})\right]} \right|$$
(7)

3 CMUT 线阵列结构设计

3.1 阵元数目与间距

选取合适的 CMUT 阵元数目需要尽可能兼顾 CMUT 阵列指向性性能、微加工工艺复杂度和系统 控制可行性等要求。声阵列的优化原则是抑制旁 瓣、消除栅瓣、保证主瓣宽度最窄。

1) CMUT 一维线阵主瓣的宽度是辐射指向角



图 5 CMUT 线性复合阵指向性模型 Fig. 5 Directivity model of CMUT linear complex array

所在波束的左右两个零交点之间的距离。令 CMUT一维线性复合阵指向性函数等于 0,即可求 出所有零交点的位置

 $D_{1\mathrm{Da}_{\mathrm{rectan\,gular}}}(0,\theta,0,\theta_s) = 0 \tag{8}$

$$\theta = \arcsin(\sin\theta_s - \frac{n\lambda}{M'd}) \tag{9}$$

其中:n≠0 且不为 M'的整数倍的整数。

n=±1时的角度代表主瓣波束两边的零交点 位置,则标准化主瓣宽度(Q_{MBW})定义为

$$Q_{
m MBW} =$$

$$\frac{1}{\pi} \left[\arcsin(\sin\theta_s + \frac{\lambda}{M'd}) - \arcsin(\sin\theta_s - \frac{\lambda}{M'd}) \right]$$
$$(0 \leqslant Q_{\text{MBW}} \leqslant 1) \tag{10}$$

2) 栅瓣幅值与主瓣幅值具有相同高度,均为1, 即CMUT一维线性复合阵指向性函数等于1,便得 到主瓣与栅瓣的位置,为了消除栅瓣,需将主瓣两边 第1个栅瓣移出[-90°,90°]范围,即可得到消除栅 瓣的条件即为

$$d \leqslant d_{\max} = \left| \frac{(M'-1)\lambda}{M'(1+\sin\theta_s)} \right| \tag{11}$$

图 6(a)为 CMUT 阵元数目对其均匀线阵主瓣



图 6 阵列参数与指向性指标之间的关系

Fig. 6 Impact of array parameter on directivity indicators

宽度 Q_{MBW} 参量的影响。可以发现,阵列数目 N=16 是个转折点,当数目增加超过16时,所引起的成本 提高和换能器纯增加与所受益的指向性轻微改善不 成比例,因此在CMUT线阵设计初期时,选取阵元 数目 N=16。图 6(b)为 CMUT16 单元均匀线阵阵 元间距与阵列指向性指标之间的关系图。蓝线为阵 列中心距与标准主瓣宽度 Q_{MBW} 之间的关系,绿线 是根据消除栅瓣最大阵元间距原则,给出的偏转方 向角与消除栅瓣最大阵元间距之间的变化情况。蓝 线表明中心间距的增大会使主瓣宽度减小,且 $d/\lambda = 0.5$ 同样是个转折点,当 $d/\lambda > 0.5$,间距增加, 主瓣宽度减小的程度逐渐缩小。绿线表明随着偏转 方向角在「0°,90°)逐渐增大的同时,其最大消除栅瓣 阵元中心间距 Q_{MBW} 在[0.48,0.97]之间反比例逐渐 减小,可以看到当间距大于等于1时,栅瓣是必然出 现的,已经与偏转方向角无关了。最终在设计中选取 $d = 0.48\lambda$ 作为16阵元线阵的阵列单元间距。

3.2 阵元结构

阵元的横向宽度 a 应该小于阵元间距,即 a < $d \leq d_{max}$ 。如果 CMUT 在宽度上由 X 个半径为 r 的 CMUT 敏感单元并联组成,则满足 2Xr < d = 0.48 λ ,计算得到在宽度上 CMUT 敏感单元的最大数目 M 为 9。由于探测性能对 CMUT 线阵纵向长度没有尺寸限制,敏感单元越多,阵元辐射声压越高,以及接收时电容变化及产生的电流越容易被电路检测,故阵元设计的纵向每列等间距排列了 50 个敏感单元,即 9×50=450 个敏感单元并行排列构成阵元。笔者设计的 CMUT16 阵元线阵几何参数如表 2 所示。图 7 为设计的 CMUT 线阵的指向性仿真情况。仿真表明,所设计的 CMUT 线阵主瓣半功率角-3 dB 为 5°,波束宽度较窄;最大旁瓣级为 -13.5 dB,扫描范围内无栅瓣干扰,存在旁瓣伪像,



图 7 CMUT 线阵指向性仿真 Fig. 7 The directivity simulation of the CMUT linear array 但影响较低。经课题组^[9-10,14]在 CMUT 晶圆级低 温硅-硅键合工艺和二氧化硅刻蚀速率等方面的研 究,对 CMUT 1×16 线阵进行了阵列制作。加工后 的 CMUT 线阵实物如图 8 所示。



图 8 CMUT 线阵实物图 Fig. 8 The physical map of CMUT linear array

| Tab | .2 Mair | 1 geom | netric p | oaramete | rs of CM | UT linea | r array |
|-----|---------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 参数 | 工作频 率/ kHz | 阵元 数目 | 阵元 形状 | 阵元间 距/μm | 阵元宽 度/μm | 阵列长 度/μm | 阵列宽 度/μm |
| 数值 | 400 | 16 | 矩形 | 1 800 | 1 700 | 9 020 | 30 600 |

表 2 CMUT 一维线阵主要几何参数

4 CMUT 封装

由于 CMUT 阵列需要应用到水下探测,所以 水密透声封装是必不可少的。超声波由 CMUT 发 出后需分别经过透声液和透声薄膜才能传播至水 中。透声薄膜用于隔离介质水和 CMUT 核心部 件,透声薄膜的选取必须使超声波尽可能小的损耗 传至水中。透声液是填充在透声薄膜和 CMUT 核 心部件之间的液体介质。CMUT 无论是工作在发 射或是接收模式下,声波都会经过水介质、透声液和 透声薄膜。为了减小超声波在异界面处的反射,当 且仅当水介质、透声液和透声薄膜3种材料声阻抗相 互接近时,超声波才能低损耗地从封装材料中透射至 水介质。根据文献[15-16],选取氨酯橡胶(声阻抗为 1.626×10⁶ kg/(m² • s),密度为1070 kg/m³,声速为 1 520 m/s)作为透声薄膜材料隔离水和核心部件 CMUT 阵列, 硅油(声阻抗为 1.26×10⁶ kg/(m² • s), 密度为 970 kg/m³,声速为 1 300 m/s)作为封装液"衔 接"核心部件 CMUT 阵列和透声薄膜聚。CMUT 阵 列水密封装示意图如图 9 所示。铜箔可以屏蔽静 电[15-16]、电磁波及各种干扰信号屏蔽。环氧树脂[15-16] 用作背衬材料,具有高阻抗、高衰减的特性,使换能器 声能经芯片前表面辐射,保持高灵敏度。由于长期在 水中工作,故选用耐腐蚀、易加工的 PVC 作为外 壳[15-16],同时还可以有效消除杂散声场干扰。

值得注意的是,图9中由于CMUT芯片上电极 金属焊盘极其微小,直接与导线焊接既难操作又极



图 9 封装结构示意图 Fig. 9 Sketch map of packing structure

易破损断裂,且下电极在阵列芯片反面,因此引入一种 PCB 板芯片封装方式,如图 10 所示。CMUT 下电极通过导电胶与 PCB 矩形覆金区域粘贴,利用金 丝键合将 16 个 CMUT 阵元上电极焊盘与 PCB 板相 应位置的焊盘相连接,屏蔽导线一端引入封装外壳, 并在 PCB 板引线孔处焊接,另一端连接控制电路,从 而实现稳固芯片,对芯片起到保护作用,避免阵列破 损。CMUT1×16 线阵的最终封装实物如图 11 所示。



Fig. 10 Schematic diagram of PCB



图 11 最终封装 Fig. 11 Final packing

5 性能测试

5.1 CMUT 指向性分析

指向性测试实验图如图 12 所示。CMUT 作为 发射端固定在精密分度转盘的下方,并随分度盘从 -90°到90°进行旋转扫描。标准压电换能器作为接 收信号端被固定在距离发射端正对面1m处,并与 CMUT保持中心平齐等高。CMUT阵列由20V 偏置电压和20V_{pp}的脉冲信号(400kHz,5-cycles) 同时激励。每旋转3°保存一组接收信号数据。 CMUT指向性测试结果如图13所示。经测试看 出,CMUT阵列指向性对称性好,-3dB主瓣半功 率角(波束宽度)为5°,最大旁瓣级为-13.5dB,伴 随较低的旁瓣干扰,且在扫描范围内无栅瓣出现。 所设计的CMUT阵列指向性测试结果与仿真结果 一致,达到了预期的效果。



图 12 CMUT 指向性测试图 Fig. 12 The directivity test diagram of CMUT



图 13 CMUT 指向性测试结果 Fig. 13 The directivity result map of CMUT

5.2 CMUT水下扇扫探测

CMUT 阵列水下扇形扫描探测系统如图 14 所示。CMUT 阵列固定在精密分读盘上,放于水槽中。两个长宽均为 1cm 的正方体放置在 CMUT 阵列前方的扫描范围内。面朝两目标物体旋转精密分度盘,-30°至 30°,CMUT 阵列发射并接收回波信号。超声扇形扫描探测是由多束 A-scan 回波信号构成。两目标物体的回波 A-scan 信号如图 15 所示。经过滤波、包络提取和对数压缩后重建的 60°

扇形扫描图如图 16 所示。该次扫描探测给出了 CMUT 阵列 60°前视 110cm 探测范围内景象,且清 晰地给出了两目标体的位置,重建图像连续性好,同 时目标轮廓明显,达到了预计探测效果。









6 结束语

根据 CMUT 阵列复合结构的特点,结合声场

特性分析,提出了 CMUT 阵列的几何结构设计依据和方法,并搭建了水下测试系统,对阵列芯片水密封装后进行了 CMUT 阵列收发性能和水下探测性能的测试分析。经测试,CMUT 阵列主瓣对称, -3 dB半功率角为5°,最大旁瓣级为-13.5 dB,扫 描范围无栅瓣,1 m 范围内扇形探测结果清晰,探测 分辨率受旁瓣影响较低。结果表明,提出的 CMUT 阵列设计和水密封装方法合理,初步实现了水下探

测应用,为改善微电容超声波换能器阵列水下探测 性能提供了设计依据。笔者提出的线阵设计和封装 方法对 CMUT 二维面阵同样有效。

参考文献

- [1] Heaney K D, Campbell R L, Snellen M. Long range acoustic measurements of an undersea volcano [J]. Journal of the Acoustical Society of America, 2013, 134(4):3299-3306.
- [2] 栾桂冬. 电容 MEMS 超声换能器研究进展[J]. 应用 声学, 2012,31(4):241-248.
 Luan Guidong. Progress in capacitive MEMS ultrasonic transducer[J]. Applied Acoustics, 2012,31(4): 241-248. (in Chinese)
- [3] Cheng Xiaoyang, Chen Jingkuang, Li Chuan, et al. A miniature capacitive ultrasonic imager array[J]. IEEE Sensors Journal, 2009, 9(6): 569-577.
- [4] Liu Chiahung, Chen Peitai. Surface micromachined capacitive ultrasonic transducer for underwater imaging
 [J]. Journal of the Chinses Institute of Engineers, 2007, 30(3):447-458.
- [5] Doody C B, Cheng X, Rich C A, et al. Modeling and characterization of CMOS-Fabricated capacitive micromachined ultrasound transducers [J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2011, 20(1):104-118.
- [6] Miao Jing, Shen Wenjiang, He Changde, et al. Microelectro-mechanical systems capacitive ultrasonic transducer with a higher electromechanical coupling coefficient[J]. Micro & Nano Letters, 2015,10(10): 541-544.
- [7] 张慧,赵晓楠,张雯,等. 空气耦合式电容微超声换能器的设计与分析[J]. 仪器仪表学报,2016,37(10): 2218-2225.

Zhang Hui, Zhao Xiaonan, Zhang Wen, et al. Design and analysis of air-coupled capacitive micromachined ultrasonic transducers[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2016, 37(10):2218-2225. (in Chinese)

[8] Oralkan Ö, Ergun A S, Johnson J A, et al. Capacitive micromachined ultrasonic transducers: next-generation arrays for acoustic imaging [J]. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2002,49:1596-1610.

- [9] Song Jinglong, Xue Chenyang, He Changde, et al. Capacitive micromachined ultrasonic transducers (CMUTs) for underwater imaging applications [J]. Sensors, 2015,15: 23205-23217.
- [10] 于佳琪. 基于 Si-SOI 键合的微电容超声波换能器设计 [D]. 太原:中北大学, 2014.
- [11] 王志凌,袁慎芳,邱雷,等. 基于压电超声相控阵方法的结构多损伤监测[J]. 振动、测试与诊断,2014,34(5):796-801.
 Wang Zhiling, Yuan Shenfang, Qiu Lei, et al. Structure multi-damage monitoring based on the piezoelectric ultrasonic phased array[J]. Journal of Vibration, Measurement & Diagnosis, 2014, 34(5):796-801. (in Chinese)
 [12] 杜巾ీ倫 生新民 養香菜 吉誉其职[M] 3 版 克克
- [12] 杜功焕,朱哲民,龚秀芳. 声学基础[M]. 3 版.南京: 南京大学出版社,2012:222-223.
- [13] 栾桂冬,张金铎,王仁乾.压电换能器和换能器阵 [M].北京:北京大学出版社,2005:1-476.
- [14] Li Yuping, He Changde, Zhang Juanting, et al. Design and analysis of capacitive micromachined ultrasonic transducer based on SU-8[J]. Key Engineering Materials, 2015,645-646:577-582.
- [15] Shih R C, Chang Y F, Chang C H, et al. Ultrasonic synthetic aperture focusing using the root-mean-square velocity [J]. Journal of Nondestructive Evaluation, 2014,33(1):12-22.
- [16] 赵鹏,张国军,刘源,等. 纳机电矢量水听器耐压结构设计[J]. 传感技术学报,2014,27(5):610-615.
 Zhao Pen, Zhang Guojun, Liu Yuan, et al. The design of pressure-resisting structure for NEMS vector hydrophone[J]. Chinese Journal of Sensors and Actuators, 2014, 27(5):610-615. (in Chinese)



第一作者简介:张睿,男,1987 年 2 月 生,博士、讲师。主要研究方向为超声 MEMS 及智能信息处理。曾发表《Design of capacitive micromachined ultrasonic transducer (CMUT) linear array for underwater imaging》(《Sensor Review》2015, Vol. 36, No. 1)等论文。 E-mail: fly_zr@126. com

通信作者简介:张永梅,女,1967年1月 生,博士、教授。主要研究方向为智能信 息处理。

E-mail: zhangym@ncut.edu.cn